## 第六章 球面透鏡檢測

完成玻璃球面透鏡的壓印之後,本章將依照表 5-9 的參數條件下,所製 作出的球面透鏡成品進行檢測,檢測項目包含幾何外形檢測、表面品質檢 測、殘留應力檢測,所使用的檢測設備皆為國科會精密儀器發展中心的設 備,包含輪廓儀、雷射干涉儀、光彈儀等,檢測設備與檢測結果在本章將 有完整的敘述。

6.1 幾何外形量測

曲率半徑的量測是使用輪廓儀進行量測,曲率半徑的容許誤差是參照 JIS B 7433 規範,常用曲率半徑的如表 6-1 所示;本實驗以模仁曲率半徑 15.1752mm 為目標 R 值,再以成品平均外徑 9.4914mm 為外徑 D 值,經由 計算的知,本實驗曲率半徑的容許誤差值為±0.008mm,量測結果如表 6-2 所示;整理結果以圖形表示,如圖 6-1 所示。經由量測結果得知,本實驗所 壓印出的球面透鏡,曲率半徑均符合 JIS B 7433 的容差規範。

| 曲率半徑 (R)     | 容差 (△R)   |
|--------------|---|
| 16以下         | ±0.005R/D 與±0.003 之中,取絕對值較大之數值  |
| 16以上~32以下    | ±0.007R/D與±2×10 <sup>-4</sup> R之中,取絕對值較大之數值   |
| 32 以上~130 以下 | ±0.015R/D與±2×10 <sup>-4</sup> R之中,取絕對值較大之數值   |
| 130以上~300以下  | ±0.025R/D與±2×10 <sup>-4</sup> R之中,取絕對值較大之數值   |
| 300以上~750以下  | ±0.05R/D與±3×10 <sup>-4</sup> R之中,取絕對值較大之數值  |
| 750 以上       | ±6×10 <sup>-5</sup> R <sup>2</sup> /D與±4×10 <sup>-7</sup> R <sup>2</sup> 之中,取絕對值較大之數值 |

表 6-1 JIS B 7433 曲率半徑容差規範

|       | 量測項目 | 曲率半徑    | 誤差值     |
|-------|------|---------|---------|
| 量測條件  |      | (mm)    | (mm)    |
| 模仁    | 品質   | 15.1752 | —       |
|       | 600  | 15.1775 | +0.0023 |
| 计原计明  | 500  | 15.1799 | +0.0047 |
| 苻壓时间  | 400  | 15.1748 | -0.0004 |
| (Sec) | 300  | 15.1807 | +0.0053 |
|       | 200  | 15.1804 | +0.0052 |
|       | 100  | 15.1766 | +0.0043 |
|       | 50   | 15.1764 | +0.0012 |

表 6-2 曲率半徑量測結果



6.2 表面品質量測

6.2.1 表面品質量測設備

表面品質檢測是使用雷射干涉儀,其重要性質如表 6-3 所示;干涉儀是 利用雷射干涉理論為基礎來進行表面輪廓量測,其設備外觀如圖 6-2 所示; 運用干涉儀可以量測待測波前(Test Wavefront)與參考波前(Reference Wavefront)之間的相位差。

干涉儀中的參考波前是由標準鏡(Transmission Spheres)反射所產生的,而待側波前則是由具有高低起伏的待測面反射所產生的。待測波前與 參考波前間的相位差可以反映此待測物的表面輪廓,形成干涉條紋如圖 6-3 所示。

由於系統的光路中含有相移技術(Phase-Shifting Technique),可以求得 上述的相位差,再利用相位重建技術(Phase Unwrapping Technique)來恢復重 建後連續分布的相位,進而推算出三維的表面輪廓結構,如圖 6-4 所示,藉 由軟體的運算可以將三維的表面輪廓結構轉換成二維的色差圖,並于以量 化,如圖 6-5 所示,同時可以在二維的色差圖選取任一截面,觀察該截面的 輪廓圖,如圖 6-6 所示。

表 6-3 干涉儀重要性質表

| 設備廠牌 | Zygo  | 型號  | OMP-0351J |
|------|-------|-----|-----------|
| 光源   | He-Ne | 標準鏡 | F/15 4"   |



圖 6-2 Zygo 干涉儀外觀圖



圖 6-3 干涉條紋



圖 6-4 三維的表面輪廓結構



圖 6-5 二維色差圖



圖 6-6 高度差截面圖

6.2.2 表面品質量測結果

在使用雷射干涉儀量測之後發現,所量測出的結果無法完整描述表面 品質,其主要原因是由於玻璃表面品質不佳所造成,以下將以實際量測的 結果進行敘述,其中所引用的圖例,均以持壓時間為400秒的參數條件下 所得到的成品,經由量測後所得到之結果。

使用干涉儀對玻璃成品進行表面品質量測,檢測結果如圖 6-7 所示,由 於玻璃表面品質不佳,使得所呈現出的干涉條紋並不明顯;在干涉條紋並 不明顯的情況下,於重建後連續分布的相位,其所推算出三維的表面輪廓 結構也僅有局部區域。

為了可以觀測局部較明顯的表面品質,將欲重建的區域範圍選取在干 涉條紋較為明顯的區域,如圖 6-8 所示,則在該區域重建連續分布的相位, 其所推算出三維的表面輪廓結構也僅該選取局部區域的輪廓結構,如圖 6-9 所示;其所計算出的表面粗糙度的均方根值與曲光力(Power)也是局部的品 質,如圖 6-10 所示;縱使已將重建範圍縮減至干涉條紋較為明顯的區域, 其局部高度差的截面曲線仍是斷斷續續,如圖 6-11 所示,其表面品質仍然 低於干涉儀所能解析的範圍,故無法完整描述表面狀況。

為了使表面品質能予以量化,故改用輪廓儀進行中心線平均值、均方 根值、波峰波谷值等表面粗糙度值的檢測,其檢測結果如表 6-2 所示,在完 成表面粗糙度的量化之後,將其所得的值製成趨勢圖,如圖 6-12 所示,由 圖形中可以得知,在壓印前玻璃平面透鏡的表面粗糙度 PRq 值已經達到 0.02~0.03μm 範圍,當持溫時間增加時,所壓印出的球面透鏡表面粗糙度 會與模仁的表面粗糙度更接近。

當模仁表面品質不佳時,會使成品的表面品質降低,其解決之道在於 鍍膜後之模仁表面品質;由於鍍膜層之研究牽扯到鍍膜層的材質與鍍膜技 術,並非本研究之主軸,故本研究並未更進一步的對鍍膜層進行探討。



圖 6-7 干涉條紋不明顯



圖 6-9 局部的三維表面輪廓結構圖



圖 6-11 局部高度差截面圖

表 6-4 表面粗糙度量測結果

| 量測條   | 量測項目件 | 壓印前<br>PRq (µm) | PRa (µm) | PRq (µm) | PRt (µm) |
|-------|-------|-----------------|----------|----------|----------|
|       | 莫仁品質  |                 | 0.2833   | 0.4594   | 3.7844   |
|       | 600   | 0.0249          | 0.2670   | 0.3795   | 2.1948   |
| 持壓    | 500   | 0.0255          | 0.2480   | 0.3428   | 2.2317   |
| 時間    | 400   | 0.0238          | 0.2259   | 0.3408   | 2.2850   |
| (Sec) | 300   | 0.0245          | 0.2254   | 0.3119   | 1.9756   |
|       | 200   | 0.0263          | 0.2523   | 0.3359   | 1.9347   |
|       | 100   | 0.0234          | 0.2397   | 0.3083   | 1.7678   |
|       | 50    | 0.0243          | 0.2111   | 0.2624   | 1.5369   |



圖 6-12 表面粗糙度比較圖

玻璃成品的殘留應力檢測設備為光彈性實驗儀(Polariscope),本實驗所 使用的光彈性實驗儀為 SHARPLES 公司所出品的一般型實驗儀,所使用的 光源為鈉單色光源(Sodium Monochromatic Illumination),可視範圍為 260mm×260mm,其外觀如圖 6-13 所示,其運用的原理與檢測結果在本節 將會有詳細的介紹。



圖 6-13 本實驗所使用之光彈性實驗儀外觀圖

光彈性實驗儀是量測應力變化之實驗儀器,其主要設備包括偏光 板、四分之一波板及光源,其示意圖如圖 6-14 所示,圖中為穿透式光彈性 實驗儀,將可透光之待測物置於光彈性實驗儀中,可用來檢驗待測物的應 力情況。

光彈性實驗儀可形成平面偏光系統或圓偏光系統,在光源後方加入一 面偏光板使之為極化器,即產生平面偏光之濾光器,使光偏極化後,再用 另一面偏光板為分析器,即傳送或接收平面偏極光之濾光器,檢查偏極光, 此第二面偏光板又稱為分析面,在兩面起偏光板中就是平面偏極光,此系 統稱為平面偏光系統。在上述兩面起偏振鏡中央加入兩片四分之一波片即 成為圓偏光系統。該兩四分之一波片的快軸與慢軸交叉排置且均與起偏振 鏡之偏振軸夾45度角。



## 圖 6-14 穿透式光彈性實驗儀配置示意圖

在光彈性材料中,由於材料平面上的兩個主應力,會使得此材料具有 兩種不同的折射率,因此當光要通過待測物時,因為沿二個主應力方向振 動的光波彼此有不同的速率,當光要穿出材料時,會有相對的相位差產生, 而此相位差正比於平面上的兩個主應力值之差值。

6.3.2 殘留應力檢測結果

由於該設備無法將殘留應利予以量化,故本檢測僅能以實際觀測到的 進行討論,檢測結果如圖 6-15 所示,從圖上觀測得知,依照此壓印參數所 壓印出的球面透鏡,在球面透鏡邊緣變形量較大之處,其色層變化較為明 顯,具有較大的殘留應力,其中更以持壓時間 600 秒最為明顯,在透鏡中 心處沒有明顯的殘留應力。



圖 6-15 殘留應力檢測結果 (圖中所標示為持壓時間)

為了確認所觀察之現象,以下將再設定一變形量較大的壓印參數,然 後進行實驗,再將實驗所得到的成品進行檢測,其實驗參數設定如表 6-5 所示,所壓印出的球面透鏡成品中心厚度為 1.98mm、外徑為 11.85mm,其 殘留應力檢測結果如圖 6-16 所示。經由檢測結果得知,不僅只有邊緣處有 中心區域亦有明顯的殘留應力,故可確認依照表 5-9 的球面透鏡熱壓參數 設定所壓印出的球面透鏡,其中心處沒有明顯的殘留應力。

| 預壓力(N)    | 壓印溫度(℃)   | 壓印力(N) | 壓印力速度(N/min) |
|-----------|-----------|--------|--------------|
| 19.6      | 490       | 490    | 49           |
| 持溫時間(Sec) | 持壓時間(Sec) | 保壓力(N) | 脫模溫度(℃)      |
| 1200      | 600       | 0      | 490          |

表 6-5 變形量較大的壓印參數設定表



圖 6-16 變形量較大之殘留應力檢測結果